

國立交通大學

機械工程研究所

碩士論文

變壓藕合電漿多晶矽乾式蝕刻機

蝕刻深度的批次控制

Run-to-Run Etching Depth Control

for TCP Poly-Silicon Etcher

研究生：顏嘉良

指導教授：林家瑞 博士

陳宗麟 博士

中華民國九十七年十二月

變壓藕合電漿多晶矽乾式蝕刻機

蝕刻深度的批次控制

Run-to-Run Etch Depth Control
for TCP Poly-Silicon Etcher

研究生：顏嘉良

Student : Chia-Liang Yen

指導教授：林家瑞 博士

Advisor : Dr. Chia-Shui Lin

陳宗麟 博士

Dr. Tsung-Lin Chen

國立交通大學

機械工程研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Mechanical Engineering

College of Engineering

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Mechanical Engineering

December 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年十二月